

- 1.分光分析手法を用いた半導体材料の欠陥評価
- 2.ライフィノベーション分野におけるイメージング分析手法の活用

第65回応用物理学会春季学術講演会 東レリサーチセンター ランチョンセミナーのご案内



◆ 日時 : 2018年3月18日 (日) 12:15~13:00

◆ 会場 : C103 (52号館)

◆ 演題 :

【半導体】

分光分析手法を用いた半導体材料の欠陥評価

【ライフィノベーション】

ライフィノベーション分野におけるイメージング分析手法の活用



株式会社 東レリサーチセンター